

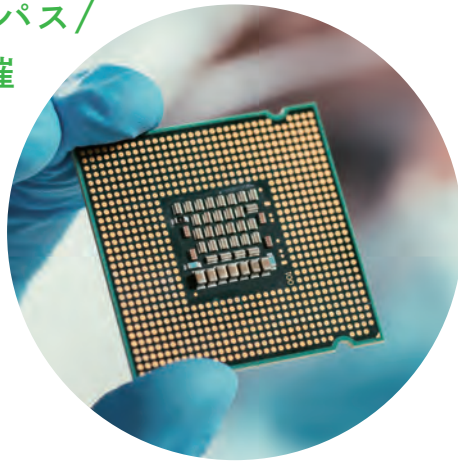
グリーン化に挑戦する 半導体製造・プロセス技術

半導体製造のグリーン化の要求が高まりを見せ、コストや性能に加えて、環境負荷低減がもう一つの評価軸になりつつあります。半導体製造は、薄膜成長、エッチング、洗浄、酸化、イオン注入など多彩なプロセスの連続で、表面科学、プラズマ科学、流体科学、非晶質・結晶、などの応用物理の各分野とのかかわりが深いものです。産学連携で議論し、問題点や関連情報を共有する場が必要と考え、その“キッカケ”となることを目指して本シンポジウムを開催します。

2022

9/21 水 13:30-17:45

東北大学川内北キャンパス/
Zoomハイブリッド開催



招待講演

- 益 一哉 : 東京工業大学
- 市村 公二 : 大日本印刷株式会社
- 堀 勝 : 名古屋大学
- 渋谷 潤 : 株式会社SCREEN
セミコンダクターソリューションズ
- 石田 真彦 : 日本電気株式会社
- 井上 史大 : 横浜国立大学
- 若林 整 : 東京工業大学

パネルディスカッション

- モデレータ 金山敏彦(産総研)
- パネリスト 招待講演者、他